



試料の微細構造を保ち、理想的な凍結状態を実現 VCTクロスリンクで開くクライオ試料作製ワークフロー



高圧凍結装置
Leica EM ICE

氷晶を限りなく小さくおさえて、厚み200 μ m、最大直径5mmまでの試料を凍結可能な高圧凍結装置です。光刺激オプションを搭載可能。



フリーズエッチング装置
Leica EM ACE900

コンタミネーションフリーで高品質な試料作製を短時間で実現できるフリーズエッチング装置です。レプリカ法の他、VCT500真空トランスファーにも対応可能。



クライオ真空トランスファー装置
Leica EM VCT500

コンタミネーションフリーで試料作製装置と各種分析装置とのクロスリンクが可能、クライオ真空トランスファーシステムです。

Leica
MICROSYSTEMS

ライカ マイクロシステムズ 株式会社

本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-9 Tel.03-6758-5650 Fax.03-5155-4336

URL <http://www.leica-microsystems.co.jp> E-mail: lmc@leica-microsystems.co.jp